

スーパークリーンルーム産学官連携研究棟 (SCR) 装置一覧

2026年4月1日現在

No.	装置番号	施設等名称	備考	
			メーカー名	型番
1	L01-104	ArF液浸レジスト塗布現像装置	東京エレクトロン	CLEAN TRACK LITHIUS i+
	L01-103	ArF液浸露光装置	Nikon	NSR-S610C
2	M01-08	KrFレジスト塗布現像装置	東京エレクトロン	CLEAN TRACK ACT 12
	M01-10	KrF露光装置	Canon	FPA-5000ES3
3	U01-102	i線レジスト塗布現像装置	東京エレクトロン	CLEAN TRACK ACT 12
	U01-101	IRアラインメント付i線露光装置	Canon	FPA-5510iZs
4	L01-104c	ArF液浸レジスト塗布現像装置	東京エレクトロン	CLEAN TRACK LITHIUS i+
5	M01-08c	KrFレジスト塗布現像装置	東京エレクトロン	CLEAN TRACK ACT 12
6	U01-102c	i線レジスト塗布現像装置	東京エレクトロン	CLEAN TRACK ACT 12
7	M01-04	レジスト塗布現像装置	東京エレクトロン	CLEAN TRACK ACT 12
8	B03-07	プラズマCVD装置	ASM	Eagle-12
9	M03-06	プラズマCVD装置	ASM	Eagle-12 Rapidfire
10	B03-06	プラズマCVD装置	Novellus systems	VECTOR
11	F03-103	プラズマCVD装置	Novellus systems	VECTOR
12	M03-01	高密度プラズマCVD装置	Novellus systems	Concept 3 Speed
13	P03-101	高密度プラズマCVD装置	三菱重工	MAPLE
14	M03-14	High-k ALD装置	東京エレクトロン	Trias
15	M06-04	メタルCVD装置	東京エレクトロン	Trias-W
16	F03-07	窒化膜LP-CVD装置	東京エレクトロン	TELFORMULA
17	P03-115	窒化膜LP-CVD装置	日立国際電気	DJ-1206VN-DF
18	M03-03	酸化膜LP-CVD (TEOS) 装置	東京エレクトロン	TELFORMULA
19	P03-103	Doped-Si LP-CVD装置	日立国際電気	DJ-1226V-DF
20	U03-101B	プラズマCVD装置	Applied Materials	PRODUCER GT Staircase
21	B06-101	バリアシードスパッタ装置	Applied Materials	Endura2 EnCoReII Ta/Cu
22	M06-03	メタルスパッタ装置	キャノンアネルバ	COSMOS I-1201
23	M06-07	メタルスパッタ装置	ULVAC	ENTRON W-300
24	B06-102	Cuめっき装置	Novellus systems	SABRE NExT
25	P06-101	Cuめっき装置	Lam Research	SABRE FX
26	M02-04	Poly-Siエッチング装置	Applied Materials	Centura DPSII/Axiom
27	M02-05	メタルエッチング装置	Applied Materials	Centura DPSII/ASPII
28	B02-101	Low-k/メタルエッチング装置	Applied Materials	Centura Enabler/DPS232
29	M02-01	酸化膜エッチング装置	東京エレクトロン	Telius SCCM-0x/DRM-0x
30	M02-10	酸化膜エッチング装置	東京エレクトロン	Telius DRM-0x/SCCM-Poly
31	B02-01	Low-kエッチング装置	東京エレクトロン	Telius SCCM-0x
32	F02-101	新材料エッチング装置	日立ハイテクノロジーズ	U-8150
33	B02-03	アッシング装置	芝浦メカトロニクス	ICE300/RPA300
34	M02-07	アッシング装置	芝浦メカトロニクス	μ ASH300
35	P02-105	アッシング装置	芝浦メカトロニクス	ICE300/μ ASH300
36	M05-03	高エネルギー中電流イオン注入装置	日新イオン機器	EXCEED2300V
37	F05-101	低エネルギー高電流イオン注入装置	住友重機械	SHX
38	M03-101	RTA/RTP装置	Applied Materials	Radiance
39	M04-02	ゲート酸化RTO/RTP装置	東京エレクトロン	Trias SPA300

No.	装置番号	施設等名称	備考	
			メーカー名	型番
40	B04-01	縦型アニール装置	光洋サーモシステム	VF-5700B
41	M04-101	縦型酸化炉	東京エレクトロン	ALPHA-303i-K
42	M07-15	バッチ式洗浄装置	東京エレクトロン	UW300Z
43	M07-07	酸化膜ウェットエッチング装置	SES	VENUS
44	P07-104	窒化膜ウェットエッチング装置	S-TEC	SFAW-1201-008
45	M07-05	バッチ式スプレー洗浄装置	東京エレクトロン	ZETA 300 BE
46	U07-103c	Si裏面研削研磨装置洗浄ユニット	ディスコ	DGP8761SC
47	M07-02	枚葉式洗浄装置	SCREEN	AQUASPIN MP-3000
48	M07-101	枚葉式洗浄装置	SCREEN	AQUASPIN SU-3000
49	M07-102	枚葉式洗浄装置	SCREEN	AQUASPIN SU-3000
50	P07-105	枚葉式洗浄装置	カナメックス	KC-A300CBT
51	M07-13	枚葉式新材料洗浄装置	SEZ	SEZ323
52	M07-09	スクラブ洗浄装置	SCREEN	AQUASPIN SS-3000
53	M07-12	スクラブ洗浄装置	SCREEN	AQUASPIN SS-3000
54	N07-101	STI、W CMP装置	東京精密	ChaMP-332M A-FP-3000M
55	P07-101	Cu CMP装置	荏原製作所	F-REX300E
56	U07-101	Oxide CMP装置	Applied Materials	Reflexion LK Oxide
57	B02-101D	Si深掘りエッチング装置	Applied Materials	Centura Silvia
58	U03-101A	プラズマCVD装置	Applied Materials	PRODUCER GT InViaII
59	U06-101	Cuめっき装置	東京エレクトロン	NEXX Cu ECD
60	U12-102	ウェハ接合装置	タツモ	WS3000
61	U07-102	ウェハエッジトリミング装置	ディスコ	DFD6860
62	U07-103	Si裏面研削研磨装置	ディスコ	DGP8761HC
63	M08-55	重ね合わせ精度測定装置	KLA-Tencor	Archer10-AIM
64	P08-116	重ね合わせ精度測定装置	KLA-Tencor	Archer10-AIM
65	M08-07	分光エリプソ膜厚測定装置	KLA-Tencor	ASET-F5
66	M08-101	分光エリプソ膜厚測定装置	KLA-Tencor	ASET-F5X
67	P08-108	分光エリプソ膜厚測定装置	日本セミラボ	$\mu$ SE-2500-A
68	I08-101	分光エリプソ膜厚測定装置	J. A. Woollam	M-2000X
69	P08-104	反射分光膜厚測定装置	Filmetrics	F50-EXR
70	M12-08	蛍光X線膜厚測定装置	リガク	System 3272E
71	P12-104	蛍光X線膜厚測定装置	Spectris	2830ZT
72	F08-04	X線回折装置	リガク	TTR In-plane XRD
73	B12-101	反り/膜応力自動測定装置	FSM	128LC2C
74	M08-12	反り/膜応力測定装置	FSM	128L
75	P08-105	パーティクル検査装置	TOPCON	WM-10
76	P08-106	パーティクル検査装置	TOPCON	WM-10
77	P08-107	全反射蛍光X線分析装置	リガク	TXRF 310Fab
78	P08-109	自動濃縮装置	イアス	Expert
	P08-113	ICP-MS質量分析装置	PerkinElmer	NexION 2000
79	M08-10	シート抵抗測定装置	KLA-Tencor	RS-100
80	P08-102	シート抵抗測定装置	日立国際電気	VR300DSE
81	P08-120	シート抵抗測定装置	Kokusai Electric	VR300DH1
82	I08-110	測長SEM装置	日立ハイテクノロジーズ	CG5000
83	L08-103	測長SEM装置	日立ハイテクノロジーズ	CG4000

No.	装置番号	施設等名称	備考	
			メーカー名	型番
84	P08-101	測長SEM装置	日立ハイテクノロジーズ	S-9380 II
85	P08-103	測長SEM装置	日立ハイテクノロジーズ	S-9380 II
86	P08-115	レビューSEM	Applied Materials	SEMVision G6
87	M08-40	光学顕微鏡	オリンパス	AL3110F
88	M08-50	光学顕微鏡	オリンパス	AL3110F
89	M12-101	光学顕微鏡	オリンパス	AL110
90	M12-102	光学顕微鏡	オリンパス	AL120
91	P08-110	超音波顕微鏡	Sonoscan	FastLine P300
92	P08-111	高精度微細形状測定機	小坂研究所	ET4000L
93	P08-112	赤外線顕微鏡システム	清和光学製作所	DSI-300SA-IR
94	P08-114	赤外線拡大鏡	タツモ	BL-3000A
95	B08-02-01	FIB 装置	日立ハイテクノロジーズ	FB2100
	AF08-402	走査透過電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	HD-2700
96	J03-117	走査電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	S-4700
97	M08-04	走査電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	S-5000
98	B08-12	走査電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	S-5200
99	J04-108	走査電子顕微鏡	日立ハイテック	SU9000II
100	J03-118	フルオートプローバ テスター	東京エレクトロン Agilent	P-12XL 4073B/N9201A
101	M08-42 M10-01	フルオートプローバ テスター	東京エレクトロン Agilent	P-12XL 4073A
102	M10-05	フルオートプローバ テスター	東京エレクトロン Agilent	P-12XL 4076
103	J03-126	セミオートプローバ	FormFactor	CM300xi